



EMMI 测试系统又名光发射显微镜，是器件失效分析中漏电定位的重要工具。P-100 EMMI 测试系统是仪准科技自有品牌，进入中国已经有 15 年之久。目前国内拥有三安光电、中兴通讯、智芯微电子、欧司朗、东南大学、北京 772 所、MPS、乐山菲尼克斯、深圳明微、国家软件测评中心等几十家知名客户。

具体规格如下：

Si 探测器	采集晶片	硅基芯片
	像素	1024 × 1024 pixel
	像素尺寸	13 微米 × 13 微米
	晶片尺寸	13.3 毫米 × 13.3 毫米
	噪音	6 electrons rms
	冷却方式	电制冷+水冷

	探测器晶片降温	-70° C
	冷却时间	小于 10 分钟（常温至-70° C）
InGaAs 探测器	采集晶片	铟砷化镓晶片
	像素	640*512 pixel
	像素尺寸	20 微米×20 微米
	图像范围	12.8 毫米 x 10.24 毫米
	冷却方式	电制冷+水冷
	探测器晶片最低降温	-70° C
	冷却时间	小于 10 分钟分钟（常温至-70° C）
探针台	尺寸	6、8、12 寸单双面探针台可选
	耐压范围	3000V 以下可选
	耐力范围	直流 10A 以内；脉冲 40A 以内可选
	探针座移动精度	0.7 微米
主机台	移动方式	电控移动
	X-Y-Z 移动范围	50*50*70 毫米（z 轴移动 100 毫米选配）
	X-Y 移动精度	1 微米
	Z 移动精度	0.2 微米
光学显微镜	品牌	日本三丰

	目镜	10X 一对
	物镜	2.5x,5x,20x,50x(100x 选配)
其它	屏蔽箱	关门自动切断光源, 内部处于暗场环境
	减震台	97%@10HZ